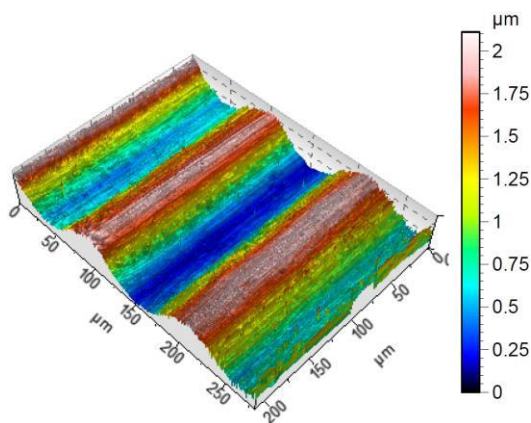
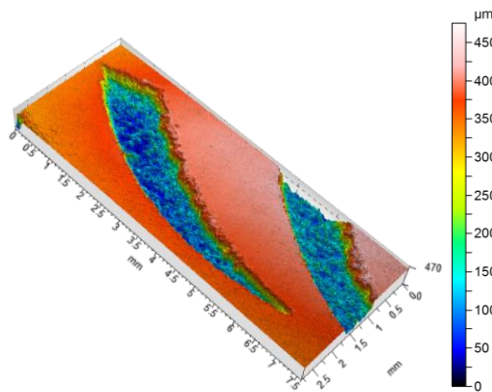




Keyence VK-9710



Aufnahme einer gedrehten Wellenoberfläche



Aufnahme eines Rückenstrukturierten PTFE-Manschettendichtrings

## Beschreibung:

- 2D- und 3D-Untersuchung für die Rauheits-, Profil- und Oberflächenmessung.
- Das Lasermikroskop verbindet die Untersuchungsfunktionen eines Oberflächen-/Rauheitsmessgeräts mit den Vorteilen eines Rasterelektronenmikroskops.
- Der Messvorgang verläuft jeweils berührungslos, womit das Messobjekt unverändert bleibt.
- Zwei verschiedene Lichtquellen, eine weiße Lichtquelle (CCD-Kamera) und eine kurzwellige Laserlichtquelle (violett).
- Mit Hilfe eines violetten Lasers wird die Oberfläche der Probe flächenhaft gerastert.
- Das optische Bild (CCD-Kamera) wird anschließend auf die Topographie projiziert.
- Auf diese Weise lassen sich die Topographien in realer Farbe darstellen.

## Technische Daten:

Messprinzip:	Laserscanning, konfokal
Lichtquelle	violetter (408 nm) Halbleiterlaser
Vertikale Auflösung	max. 1 nm
Laterale Auflösung	max. 260 nm

## Untersuchungsmöglichkeiten

- 3D-Rauheitskennwerte nach DIN EN ISO 25178
- 2D-Rauheitskenngrößen zur Auswertung nach DIN EN ISO 4287 und Vorgehen nach 4288 und VDA 2006
- Vermessen von Abstände, Tiefen, Volumen und Geometrien
- Verschleißmessungen, Laufspurverschleiß eines RWDR auf einer Welle, etc.
- Schadensanalyse: Kratzer und Fehlstellen